

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-298461

(43)Date of publication of application : 11.10.2002

(51)Int.Cl.

G11B 11/105

(21)Application number : 2001-101949

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing : 30.03.2001

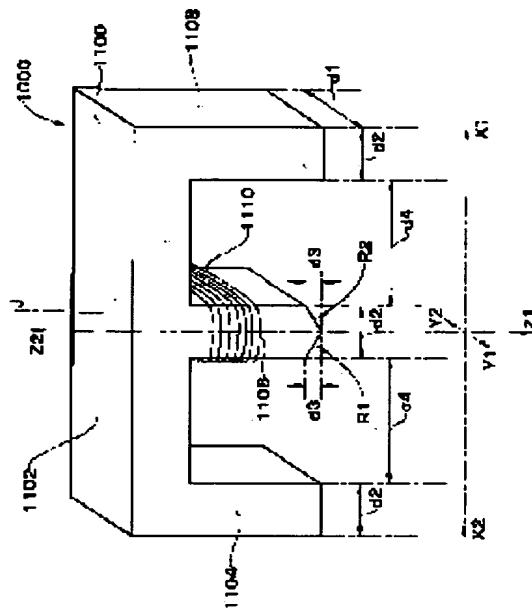
(72)Inventor : MITANI KENICHIRO
TAKAGI NAOYUKI
NOGUCHI HITOSHI
YAMAGUCHI ATSUSHI
ISHIDA KOKI

(54) MAGNETIC HEAD AND RECORDING AND REPRODUCING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic head that can apply a magnetic field modulated by a recording signal to a magneto-optical recording medium in its vertical direction at signal recording and apply an alternate magnetic field to the magneto-optical recording medium at a prescribed angle in the vertical direction at signal reproduction and to provide a recording and reproducing device employing the magnetic head.

SOLUTION: A 2nd leg 1106 of the magnetic head 1000 has a sharpened shape and a 1st slope face R1 and a 2nd slope face R2. In particular, with $d_1=200 \mu\text{m}$, $d_2=200 \mu\text{m}$, and $d_4=500 \mu\text{m}$, d_3 that is a cut amount of the slope face is preferably selected to be $70 \mu\text{m}$.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-298461

(P2002-298461A)

(43)公開日 平成14年10月11日 (2002.10.11)

(51) Int.Cl.
G 11 B 11/105

識別記号
5 6 1

F I
G 11 B 11/105

テ-マコ-ト(参考)
5 6 1 E 5 D 0 7 5

5 6 3
5 8 1
5 8 6

5 6 1 P
5 6 3 J
5 8 1 H
5 8 6 M

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 19 頁)

(21)出願番号 特願2001-101949(P2001-101949)

(22)出願日 平成13年3月30日 (2001.3.30)

(71)出願人 000001889

三洋電機株式会社
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72)発明者 三谷 健一郎

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(72)発明者 ▲高▼木 直之

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(74)代理人 100074022

弁理士 長屋 文雄 (外1名)

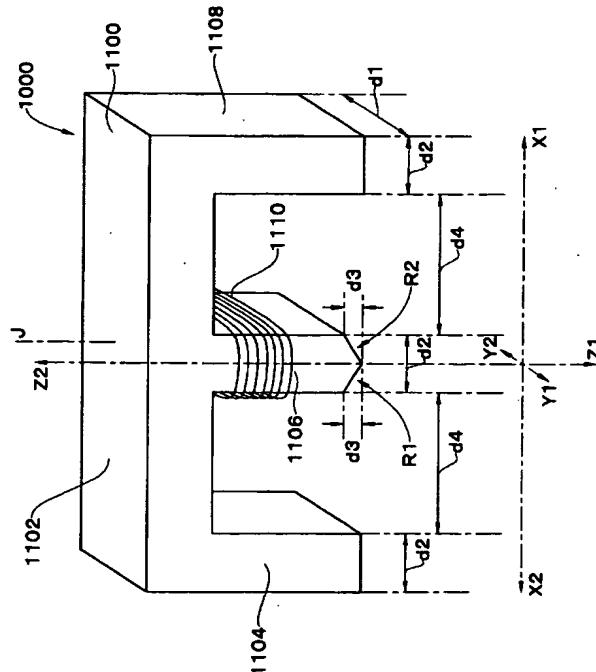
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 磁気ヘッド及び記録再生装置

(57)【要約】

【課題】 信号の記録時には光磁気記録媒体の垂直方向から記録信号により変調された磁界を印加でき、信号の再生時には光磁気記録媒体の該垂直方向に対して所定の角度を成す交番磁界を印加できる磁気ヘッドと該磁気ヘッドを用いた記録再生装置を提供する。

【解決手段】 磁気ヘッド1000における第2の脚部1106は尖った形状を呈し、第1の傾斜面R1と第2の傾斜面R2を有している。特に、d1=200μm、d2=200μm、d4=500μmとした場合に、傾斜面の削り量であるd3は、70μmとするのが好ましい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光磁気記録媒体に磁界を印加する磁気ヘッドであって、

同一方向に所定の間隔を介して配設された第1の脚部と、第2の脚部と、第3の脚部とを有し、該第2の脚部が該第1の脚部と該第3の脚部の間に配設されているコアであって、第2の脚部の先端に、第1の傾斜面と第2の傾斜面が形成されていることにより、第2の脚部が先端側に尖った形状を呈し、該第1の傾斜面が平面状で、第1の脚部側に傾斜しており、該第2の傾斜面が平面状で、第3の脚部側に傾斜しているコアと、
該第2の脚部に巻回されたコイルと、を有することを特徴とする磁気ヘッド。

【請求項2】 上記第1の脚部と第2の脚部と第3の脚部における各脚部が、ある方向としてのX方向に所定の間隔を介して配設され、該各脚部の先端が、該X方向とは直交するZ方向の一方の方向であるZ1方向を向いており、また、該X方向とZ方向のそれぞれに直交する方向をY方向とした場合に、各脚部のX方向の幅が200μmで、各脚部のY方向の幅が200μmで、第1の脚部と第2の脚部間の間隔が500μmで、第2の脚部と第3の脚部間の間隔が500μmであるとした場合に、第2の脚部の先端である第1の傾斜面と第2の傾斜面の接続位置である第1の角部と、第1の傾斜面の後端側の端部であって、該第1の傾斜面と、第2の脚部の第1の脚部側の側面との接続位置であり、第1の傾斜面の後端側の端部である第2の角部との間のZ方向の間隔が70μmであることを特徴とする請求項1に記載の磁気ヘッド。

【請求項3】 光磁気記録媒体に磁界を印加する磁気ヘッドであって、

同一方向に所定の間隔を介して配設された第1の脚部と、第2の脚部と、第3の脚部とを有し、該第2の脚部が該第1の脚部と該第3の脚部の間に配設されているコアであって、第2の脚部の先端に、第1の脚部又は第3の脚部側に傾斜した平面状の傾斜面であって、第2の脚部における第1の脚部側の端部から第2の脚部の第3の脚部側の端部までに渡る1つの傾斜面が形成されたコアと、
該第2の脚部に巻回されたコイルと、を有することを特徴とする磁気ヘッド。

【請求項4】 上記第1の脚部と第2の脚部と第3の脚部における各脚部が、ある方向としてのX方向に所定の間隔を介して配設され、該各脚部の先端が、該X方向とは直交するZ方向の一方の方向であるZ1方向を向いており、また、該X方向とZ方向のそれぞれに直交する方向をY方向とした場合に、各脚部のX方向の幅が200μmで、各脚部のY方向の幅が200μmで、第1の脚部と第2の脚部間の間隔が500μmで、第2の脚部と第3の脚部間の間隔が500μmであるとした場合に、

上記傾斜面の第1の脚部側の端部と、上記傾斜面の第3の脚部側の端部とのZ方向の間隔が150μmであることを特徴とする請求項3に記載の磁気ヘッド。

【請求項5】 光磁気記録媒体に信号を記録するとともに、光磁気記録媒体に記録された信号を再生する記録再生装置であって、

磁界を発生する磁気ヘッドであって、請求項1又は2又は3又は4に記載の磁気ヘッドで、上記第1の脚部と、第2の脚部と、第3の脚部とが配設される方向が光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向に沿うように配設された磁気ヘッドと、

光磁気記録媒体にレーザ光を照射し、その反射光を検出する光ピックアップと、

光磁気記録媒体への信号の記録時には、光磁気記録媒体の記録位置に印加される磁界の最大磁力成分が、光ピックアップからのレーザ光の光軸の方向と平行になるよう、該磁気ヘッドを位置制御するとともに、

光磁気記録媒体からの信号の再生時には、光磁気記録媒体の再生対象の磁区に印加される磁界の最大磁力成分が、光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向の磁界成分を有するように、該磁気ヘッドを位置制御する磁気ヘッド位置制御部と、を有することを特徴とする記録再生装置。

【請求項6】 上記磁気ヘッド位置制御部は、磁気ヘッドを光ピックアップに対して相対的に光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向に移動制御することにより、磁気ヘッドの位置制御を行なうことを特徴とする請求項5に記載の記録再生装置。

【請求項7】 上記磁気ヘッド位置制御部が、光磁気記録媒体からの信号の再生時には、光磁気記録媒体の再生対象の磁区に印加される磁界の最大磁力成分が、所定の平面であって、光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向を向くとともにレーザ光の光軸を含む平面上にあり、さらに、該最大磁力成分が、光軸の方向に対して傾斜した方向を有しているように、上記磁気ヘッドを位置制御することを特徴とする請求項5又は6に記載の記録再生装置。

【請求項8】 光磁気記録媒体からの再生時において、再生対象の磁区に印加される磁界の最大磁力成分の該タンジェンシャル方向に対する角度が、45度～55度であることを特徴とする請求項5又は6又は7に記載の記録再生装置。

【請求項9】 上記記録再生装置において、所定の信号パターンを光磁気記録媒体に記録した後、磁気ヘッドを所定の移動量移動させた上で、記録した上記信号パターンを再生し、その後、記録した上記所定の信号パターンと再生した信号パターンとの一致度を判定して、該一致度が所定の範囲内にない場合には、該移動量を変化させて、再度記録した上記信号パターンを再生し、その後、記録した上記所定の信号パターンと移動量

を変化させた後に再生した信号パターンとの一致度を判定し、該一致度が上記所定の範囲内にない場合には、移動量を変化させた後に記録した上記信号パターンを再生し、信号パターンの一致度を判定する処理を繰り返すことを特徴とする請求項5又は6又は7又は8に記載の記録再生装置。

【請求項10】 光磁気記録媒体からの信号の再生時には、光磁気記録媒体から信号を再生する前に、所定の信号パターンを光磁気記録媒体に記録する記録工程と、

磁気ヘッドを光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向に所定の移動量移動させる移動工程と、
移動工程の後に、光磁気記録媒体に記録された上記所定の信号パターンを再生する再生工程と、
上記記録工程で記録された信号パターンと上記再生工程で再生された信号パターンを比較してその一致度を判定する判定工程と、

上記判定工程において、上記一致度が所定の範囲内にない場合には、上記移動量を変化させて移動させる移動量変化工程と、

該移動量変化工程において変化された後の移動量だけ磁気ヘッドを移動させた上で、光磁気記録媒体に記録された上記所定の信号パターンを再生する第2再生工程と、
上記記録工程で記録された信号パターンと上記第2再生工程で再生された信号パターンを比較してその一致度を判定する第2判定工程と、

該第2判定工程において上記一致度が所定の範囲内にない場合には、上記移動量変化工程と、第2再生工程と、第2判定工程を繰り返し、直近に行われた第2判定工程において上記一致度が所定の範囲内にない場合には、上記移動量変化工程と、第2再生工程と、第2判定工程を1又は複数回繰り返す繰り返し工程と、を行なうことを特徴とする請求項5又は6又は7又は8又は9に記載の記録再生装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、光磁気記録媒体に記録再生を行なう記録再生装置と、この記録再生装置に用いる磁気ヘッドに関するものであり、特に、記録層の記録磁区を磁区拡大再生層に転写拡大するタイプの光磁気媒体に記録再生を行なう記録再生装置と、この記録再生装置に用いる磁気ヘッドに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 光磁気記録媒体は、書換え可能で、記憶容量が大きく、かつ、信頼性の高い記録媒体として注目されており、コンピュータメモリ等として実用化され始めている。

【0003】 特に、記録層の磁区を拡大再生層へ拡大転写して信号を再生する磁区拡大再生方式がある。これは、例えば、日本応用磁気学会誌Vol. 21, No.

10, pp. 1187-1192 (1997)において提案されていて、この技術は、MAMMOS (Magnetic Amplifying Magneto-Optical System) と呼ばれている
この方式において使用される光磁気記録媒体は、図26のように形成されていて、透明基板5000の上に保護層5002、拡大再生層（以下単に「再生層」という場合もある）5004、中間層5006、記録層5008、保護層5010が順次積層された構造となっている。

【0004】 ここで、該磁区拡大再生方式による光磁気記録媒体への信号記録に際しては、光磁気記録媒体に垂直な方向から、記録信号により変調された磁界を印加し、記録層に方向の異なる磁化を有する磁区を形成する。

【0005】 一方、該磁区拡大再生方式による光磁気記録媒体からの信号再生に際しては、光磁気記録媒体に垂直な方向から一定周期の交番磁界を印加することにより記録層の磁区を再生層に転写・拡大し、その転写・拡大した磁区をレーザ光により検出する。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、光磁気記録媒体の磁区に対して垂直方向から交番磁界を印加する従来の磁区拡大再生方式においては、記録層に形成する磁区長が短くなった場合、つまり記録層に形成された磁区のタンジェンシャル方向の長さが短い場合には、磁区が再生層に正しく転写されにくいという問題を有していた。

【0007】 この問題を解決するために、光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向に対して所定の角度を成す交番磁界を印加することにより、磁区の片端部における漏洩磁界的面内成分を大きくして、磁区の片端部からの再生層への転写を促進することが提案されている（三谷、山口、高木、久米、栗野、笠島、太田：日本応用磁気学会誌、24, 395-398 (2000)）。

【0008】 ここで、光磁気記録媒体の面内方向に対して所定の角度を成す交番磁界を印加して信号を磁区拡大再生するには、光磁気記録媒体の面内方向に対して所定の角度を成す交番磁界を生成する専用の磁気ヘッドを用いなければならない。一方、光磁気記録媒体への信号記録には、光磁気記録媒体の垂直方向から磁界を印加する必要がある。従って、従来の磁気ヘッドにおいては、信号の記録時には光磁気記録媒体の垂直方向から記録信号により変調された磁界を印加し、信号の再生時には光磁気記録媒体の面内方向に対して所定の角度を成す交番磁界を印加することができないという問題があった。

【0009】 そこで、本発明は、そのような問題を解決し、信号の記録時には光磁気記録媒体の垂直方向から記録信号により変調された磁界を印加でき、信号の再生時には光磁気記録媒体の該垂直方向に対して所定の角度を成す交番磁界を印加できる磁気ヘッドと該磁気ヘッドを

用いた記録再生装置を提供することを目的とするものである。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は上記問題点を解決するために創作されたものであって、第1には、光磁気記録媒体に磁界を印加する磁気ヘッドであって、同一方向に所定の間隔を介して配設された第1の脚部と、第2の脚部と、第3の脚部とを有し、該第2の脚部が該第1の脚部と該第3の脚部との間に配設されているコアであって、第2の脚部の先端に、第1の傾斜面と第2の傾斜面が形成されていることにより、第2の脚部が先端側に尖った形状を呈し、該第1の傾斜面が平面状で、第1の脚部側に傾斜しており、該第2の傾斜面が平面状で、第3の脚部側に傾斜しているコアと、該第2の脚部に巻回されたコイルと、を有することを特徴とする。

【0011】よって、この第1の構成の磁気ヘッドによれば、特に、光磁気記録媒体の法線方向に対して傾斜した磁界を発生させることができる。

【0012】また、第2には、上記第1の構成において、上記第1の脚部と第2の脚部と第3の脚部における各脚部が、ある方向としてのX方向に所定の間隔を介して配設され、該各脚部の先端が、該X方向とは直交するZ方向の一方の方向であるZ1方向を向いており、また、該X方向とZ方向のそれぞれに直交する方向をY方向とした場合に、各脚部のX方向の幅が200μmで、各脚部のY方向の幅が200μmで、第1の脚部と第2の脚部間の間隔が500μmで、第2の脚部と第3の脚部間の間隔が500μmであるとした場合に、第2の脚部の先端である第1の傾斜面と第2の傾斜面の接続位置である第1の角部と、第1の傾斜面の後端側の端部であって、該第1の傾斜面と、第2の脚部の第1の脚部側の側面との接続位置であり、第1の傾斜面の後端側の端部である第2の角部との間のZ方向の間隔が70μmであることを特徴とする。

【0013】のことにより、磁気ヘッドの位置ずれマージンが最も良好な状態で動作させることができるとなる。

【0014】また、第3には、光磁気記録媒体に磁界を印加する磁気ヘッドであって、同一方向に所定の間隔を介して配設された第1の脚部と、第2の脚部と、第3の脚部とを有し、該第2の脚部が該第1の脚部と該第3の脚部の間に配設されているコアであって、第2の脚部の先端に、第1の脚部又は第3の脚部側に傾斜した平面状の傾斜面であって、第2の脚部における第1の脚部側の端部から第2の脚部の第3の脚部側の端部までに渡る1つの傾斜面が形成されたコアと、該第2の脚部に巻回されたコイルと、を有することを特徴とする。

【0015】よって、この第3の構成の磁気ヘッドによれば、特に、光磁気記録媒体の法線方向に対して傾斜した磁界を発生させることができる。

【0016】また、第4には、上記第3の構成において、上記第1の脚部と第2の脚部と第3の脚部における各脚部が、ある方向としてのX方向に所定の間隔を介して配設され、該各脚部の先端が、該X方向とは直交するZ方向の一方の方向であるZ1方向を向いており、また、該X方向とZ方向のそれぞれに直交する方向をY方向とした場合に、各脚部のX方向の幅が200μmで、各脚部のY方向の幅が200μmで、第1の脚部と第2の脚部間の間隔が500μmで、第2の脚部と第3の脚部間の間隔が500μmであるとした場合に、上記傾斜面の第1の脚部側の端部と、上記傾斜面の第3の脚部側の端部とのZ方向の間隔が150μmであることを特徴とする。

【0017】のことにより、磁気ヘッドの位置ずれマージンが最も良好な状態で動作させることができるとなる。

【0018】また、第5には、光磁気記録媒体に信号を記録するとともに、光磁気記録媒体に記録された信号を再生する記録再生装置であって、磁界を発生する磁気ヘッドであって、請求項1又は2又は3又は4に記載の磁気ヘッドで、上記第1の脚部と、第2の脚部と、第3の脚部とが配設される方向が光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向に沿うように配設された磁気ヘッドと、光磁気記録媒体にレーザ光を照射し、その反射光を検出する光ピックアップと、光磁気記録媒体への信号の記録時には、光磁気記録媒体の記録位置に印加される磁界の最大磁力成分が、光ピックアップからのレーザ光の光軸の方向と平行になるように、該磁気ヘッドを位置制御とともに、光磁気記録媒体からの信号の再生時には、光磁気記録媒体の再生対象の磁区に印加される磁界の最大磁力成分が、光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向の磁界成分を有するように、該磁気ヘッドを位置制御する磁気ヘッド位置制御部と、を有することを特徴とする。

【0019】この第5の構成の記録再生装置によれば、光磁気記録媒体への信号の記録時には、光磁気記録媒体の法線方向に磁界を印加でき、また、光磁気記録媒体からの再生時には、光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向に磁界を印加できるので、信号の記録と再生を正確に行なうことができる。

【0020】また、第6には、上記第5の構成において、上記磁気ヘッド位置制御部は、磁気ヘッドを光ピックアップに対して相対的に光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向に移動制御することにより、磁気ヘッドの位置制御を行なうことを特徴とする。

【0021】また、第7には、上記第5又は第6の構成において、上記磁気ヘッド位置制御部が、光磁気記録媒体からの信号の再生時には、光磁気記録媒体の再生対象の磁区に印加される磁界の最大磁力成分が、所定の平面であって、光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向を向くとともにレーザ光の光軸を含む平面上にあり、さら

に、該最大磁力成分が、光軸の方向に対して傾斜した方向を有しているように、上記磁気ヘッドを位置制御することを特徴とする。

【0022】また、第8には、上記第5から第7までのいずれかの構成において、光磁気記録媒体からの再生時において、再生対象の磁区に印加される磁界の最大磁力成分の該タンジェンシャル方向に対する角度が、45度～55度であることを特徴とする。

【0023】また、第9には、上記第5から第8までのいずれかの構成において、上記記録再生装置において、所定の信号パターンを光磁気記録媒体に記録した後、磁気ヘッドを所定の移動量移動させた上で、記録した上記信号パターンを再生し、その後、記録した上記所定の信号パターンと再生した信号パターンとの一致度を判定して、該一致度が所定の範囲内にない場合には、該移動量を変化させて、再度記録した上記信号パターンを再生し、その後、記録した上記所定の信号パターンと移動量を変化させた後に再生した信号パターンとの一致度を判定し、該一致度が上記所定の範囲内にない場合には、移動量を変化させた後に記録した上記信号パターンを再生し、信号パターンの一致度を判定する処理を繰り返すことを特徴とする。

【0024】よって、再生時に磁気ヘッドを移動制御する場合に、適切な移動量とすることが可能となる。

【0025】また、第10には、上記第5から第9までのいずれかの構成において、光磁気記録媒体からの信号の再生時には、光磁気記録媒体から信号を再生する前に、所定の信号パターンを光磁気記録媒体に記録する記録工程と、磁気ヘッドを光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向に所定の移動量移動させる移動工程と、移動工程の後に、光磁気記録媒体に記録された上記所定の信号パターンを再生する再生工程と、上記記録工程で記録された信号パターンと上記再生工程で再生された信号パターンを比較してその一致度を判定する判定工程と、上記判定工程において、上記一致度が所定の範囲内にない場合には、上記移動量を変化させて移動させる移動量変化工程と、該移動量変化工程において変化された後の移動量だけ磁気ヘッドを移動させた上で、光磁気記録媒体に記録された上記所定の信号パターンを再生する第2再生工程と、上記記録工程で記録された信号パターンと上記第2再生工程で再生された信号パターンを比較してその一致度を判定する第2判定工程と、該第2判定工程において上記一致度が所定の範囲内にない場合には、上記移動量変化工程と、第2再生工程と、第2判定工程を繰り返し、直近に行われた第2判定工程において上記一致度が所定の範囲にない場合には、上記移動量変化工程と、第2再生工程と、第2判定工程を1又は複数回繰り返す繰り返し工程と、を行なうことを特徴とする。

【0026】よって、再生時に磁気ヘッドを移動制御する場合に、適切な移動量とすることが可能となる。

【0027】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態としての実施例を図面を利用して説明する。本発明に基づく記録再生装置Aは、磁気ヘッド1000と、磁気ヘッド保持・移動機構10と、光ピックアップ27と、再生信号增幅回路100と、同期信号生成回路120と、サーボ回路130と、サーボ機構140と、スピンドルモータ150と、BPF(バンドパスフィルタ)160と、イコライザ170と、復調回路220と、比較回路230と、制御回路235と、エンコーダ240と、変調回路250と、駆動信号生成回路260と、磁気ヘッド駆動回路280と、レーザ駆動回路290とを有している。

【0028】ここで、磁気ヘッド1000は、コア1100と、コイル1110とを有している。

【0029】ここで、コア1100は、略E型鉄心であり、平板状の直方体形状の基部1102と、該基部1102から突出した3つの脚部、すなわち、第1の脚部1104と、第2の脚部1106と、第3の脚部1108とを有している。このコア1100は、全体に一体に形成されていて、このコア1100は、フェライトにより形成されている。なお、第1の脚部1104と、第2の脚部1106と、第3の脚部1108の各脚部は、直方体形状を呈している。

【0030】なお、このコア1100の第1の脚部1104と第2の脚部1106と第3の脚部1108において、Y1側の面は同一平面上にあり、Y側の面も同一平面上にあり、Z1側の面も同一平面上にある。

【0031】なお、第2の脚部1106の先端は、略山形形状をしており、X1-X2方向とY1-Y2方向を含む平面に対して傾斜した第1の傾斜面R1と、第2の傾斜面R2を有している。第1の傾斜面R1と第2の傾斜面R2は平面を呈し、第1の傾斜面R1と第2の傾斜面R2とが接する部分は直線を呈し、該直線はY1-Y2方向を向いている。また、第1の傾斜面R1と第2の脚部1106の第1の脚部1104側の側面とが接する部分も直線を呈し、該直線もY1-Y2方向を向いている。同様に、第2の傾斜面R2と第2の脚部1106の第3の脚部1108側の側面とが接する部分も直線を呈し、該直線もY1-Y2方向を向いている。また、第1の傾斜面R1のZ1-Z2方向の幅(d3)と、第2の傾斜面R2のZ1-Z2方向の幅(d3)は同一となっている。

【0032】つまり、この第2の脚部1106は、Y1-Y2方向とZ1-Z2方向を含む平面で、第2の脚部1106のX1-X2方向の中心を通る平面を介して、左右対象の形状となっている。また、第2の脚部1106の断面で、X1-X2方向とZ1-Z2方向を含む平面による断面は、Y1-Y2方向のいずれの位置においても同じ形状となっている。

【0033】また、このコア1100における第2の脚

部1106には、コイル1110が巻回されている。

【0034】なお、この磁気ヘッド1000の寸法は以下のようにになっている。すなわち、図2において、 $d_1 = 200\mu m$ 、 $d_2 = 200\mu m$ 、 $d_4 = 500\mu m$ となっている。また、 $Z_1 - Z_2$ 方向の軸線Jは、磁気ヘッド1000において、 $Z_1 - Z_2$ 方向をなし、第2の脚部1106において、 $X_1 - X_2$ 方向及び $Y_1 - Y_2$ 方向の中心を通る線である。

【0035】なお、磁気ヘッド1000は、実際には、図2に示す状態のものが樹脂に埋設されて磁気ヘッド1000を形成している。

【0036】本実施例の磁気ヘッド1000が上記のように構成されることにより、コア1100に巻回されたコイル1110に電流を流すことにより、図3に示すように、ほぼ放射状の磁界が発生されることになる。つまり、第1の傾斜面R1から照射されると磁界と、第2の傾斜面R2から照射される磁界が主として発生され、第1の傾斜面R1から照射される磁界の最大磁界成分は、第1の傾斜面R1とほぼ垂直の方向を向いており、第2の傾斜面R2から照射される磁界の最大磁界成分は、第2の傾斜面R2とほぼ垂直の方向を向いている。また、 $X_1 - X_2$ 方向の中心位置では、第1の傾斜面R1からの磁界と第2の傾斜面R2からの磁界が合成されることにより、 $Z_1 - Z_2$ 方向にはほぼ平行な磁界が発生される。なお、この磁気ヘッド1000のタイプの磁気ヘッドを以下では「第1タイプの磁気ヘッド」あるいは「タイプAの磁気ヘッド」と呼ぶこともある。

【0037】上記磁気ヘッド1000の代わりに、以下に説明する磁気ヘッド2000を用いてもよい。なお、この磁気ヘッド2000のタイプの磁気ヘッドを以下では「第2タイプの磁気ヘッド」あるいは「タイプBの磁気ヘッド」と呼ぶこともある。

【0038】磁気ヘッド2000は、図4に示すように、コア2100と、コイル2110とを有している。

【0039】ここで、コア2100は、略E型鉄心であり、平板状の直方体形状の基部2102と、該基部2102から突出した3つの脚部、すなわち、第1の脚部2104と、第2の脚部2106と、第3の脚部2108とを有している。このコア2100は、全体に一体に形成されていて、このコア2100は、フェライトにより形成されている。なお、第1の脚部2104と、第2の脚部2106と、第3の脚部2108の各脚部は、直方体形状を呈している。

【0040】なお、第2の脚部2106の先端は、くさび形形状をしており、 $X_1 - X_2$ 方向と $Y_1 - Y_2$ 方向を含む平面に対して傾斜した傾斜面R3を有している。傾斜面R3は平面を呈している。また、傾斜面R3と第2の脚部2106の第1の脚部2104側の側面とが接する部分も直線を呈し、該直線も $Y_1 - Y_2$ 方向を向いている。同様に、傾斜面R3と第2の脚部2106の第

3の脚部2108側の側面とが接する部分も直線を呈し、該直線も $Y_1 - Y_2$ 方向を向いている。

【0041】つまり、第2の脚部2106の断面で、 $X_1 - X_2$ 方向と $Z_1 - Z_2$ 方向を含む平面による断面は、 $Y_1 - Y_2$ 方向のいずれの位置においても同じ形状となっている。

【0042】つまり、傾斜面R3は、第2の脚部2106の先端に、第1の脚部2104又は第3の脚部2108側に傾斜した平面状の傾斜面であって、第2の脚部2106における第1の脚部2104側の端部から第2の脚部2104の第3の脚部2108側の端部までに渡る1つの傾斜面が形成されているといえる。

【0043】また、このコア2100における第2の脚部2106には、コイル2110が巻回されている。

【0044】なお、この磁気ヘッド2000の寸法は以下のようにになっている。すなわち、図4において、 $d_1 = 200\mu m$ 、 $d_2 = 200\mu m$ 、 $d_4 = 500\mu m$ となっている。また、 $Z_1 - Z_2$ 方向の軸線Jは、磁気ヘッド2000において、 $Z_1 - Z_2$ 方向をなし、第2の脚部2106において、 $X_1 - X_2$ 方向及び $Y_1 - Y_2$ 方向の中心を通る線である。

【0045】なお、磁気ヘッド2000は、実際には、図4に示す状態のものが樹脂に埋設されて磁気ヘッド2000を形成している。

【0046】本実施例の磁気ヘッド2000が上記のように構成されることにより、コア2100に巻回されたコイル2110に電流を流すことにより、図5に示すように、 $Z_1 - Z_2$ 方向に対して斜め方向の磁界が発生されることになる。つまり、発生する磁界の最大磁界成分は、傾斜面R3とほぼ垂直の方向を向いている。

【0047】なお、磁気ヘッド1000は、第1の脚部1104と第2の脚部1106と第3の脚部1108の配設方向、つまり、 $X_1 - X_2$ 方向がタンジェンシャル方向に平行になるように配設される。また、磁気ヘッド2000は、第1の脚部2104と第2の脚部2106と第3の脚部2108の配設方向、つまり、 $X_1 - X_2$ 方向がタンジェンシャル方向に平行になるように配設される。

【0048】上記のような構成の磁気ヘッド1000、2000におけるシミュレーション結果を図6～図11に示す。なお、このシミュレーションにおいて、コイル1110、2110に印加される電流は200mAであり、コイル1110、2110のターン数は16と仮定している。

【0049】ここで、図6は、図2に示す磁気ヘッド1000について、第2の脚部1106の先端の削り量、すなわち、 d_3 の長さを $0\mu m$ 、 $40\mu m$ 、 $80\mu m$ とした場合に、磁気ヘッド1000の $X_1 - X_2$ 方向の位置と、磁界強度との関係を示すものである。ここで、この磁界強度は、磁気ヘッド1000の第2の脚部2106の第

6のY1-Y2方向の中心位置から20μm離れた位置におけるX1-X2方向の位置の磁界強度を示している。つまり、図6において、Xが0μmの位置とは、図12における点Pを示しており、Xが100μmの位置とは、図12における点Qを示している。また、図7は、図2に示す磁気ヘッド1000について、第2の脚部1106の先端の削り量、すなわち、d3の長さを0μm、40μm、80μmとした場合に、磁気ヘッド1000のX1-X2方向の位置と、磁界角度の関係を示すものである。ここで、この磁界角度は、磁気ヘッド1000の第2の脚部1106のY1-Y2方向の中心位置から20μm離れた位置におけるX1-X2方向の位置のZ1-Z2方向に対する磁界角度を示している。

【0050】また、図8は、図4に示す磁気ヘッド200について図6と同様の内容を示すものである。また、図9は、図4に示す磁気ヘッド2000について図7と同様の内容を示すものである。つまり、図8は、図4に示す磁気ヘッド2000について、第2の脚部2106の先端の削り量、すなわち、d3の長さを0μm、40μm、80μmとした場合に、磁気ヘッド2000のX1-X2方向の位置と、磁界強度との関係を示すものである。ここで、この磁界強度は、磁気ヘッド2000の第2の脚部2106のY1-Y2方向の中心位置から20μm離れた位置におけるX1-X2方向の位置の磁界強度を示している。また、図9は、図4に示す磁気ヘッド2000について、第2の脚部2106の先端の削り量、すなわち、d3の長さを0μm、40μm、80μmとした場合に、磁気ヘッド2000のX1-X2方向の位置と、磁界角度の関係を示すものである。ここで、この磁界角度は、磁気ヘッド2000の第2の脚部2106のY1-Y2方向の中心位置から20μm離れた位置におけるX1-X2方向の位置のZ1-Z2方向に対する磁界角度を示している。

【0051】また、図10は、磁気ヘッド1000と磁気ヘッド2000のそれぞれについて、X1-X2方向の位置と、位置ずれマージンとの関係を示すものである。この位置ずれマージンとは、「光磁気記録媒体の法線方向に対する磁界角度が35度～45度となる。」という条件と、「磁界角度が40度となるような位置での磁界強度に対して、磁界強度が±10%以内となる。」という条件の双方を満たすために、X1-X2方向にどれだけ位置ずれが許容されるかを示すものであり、例えば、該位置ずれマージンが80μmであるとした場合には、ある位置を中心として合計80μmの範囲内であれば、上記の2つの条件を満たすことを意味している。

【0052】また、図11は、磁気ヘッド1000と磁気ヘッド2000のそれぞれについて、第2の脚部1106、2106の先端の削り量、つまり、d3の値と、磁界強度との関係を示すものである。この場合の磁界強度とは、磁気ヘッド1000、2000の第2の脚部1

106、2106のY1-Y2方向の中心位置からZ2方向に20μm離れた位置からX1-X2方向に100μmの位置の磁界角度を示している。つまり、図12、図13において、点Qの位置の磁界強度を示している。

【0053】この図6～図11に示すシミュレーション結果によれば、図2に示す磁気ヘッド1000の場合には、図10の位置ずれマージンからすると、削り量d3が70μm程度であるのが好ましく、また、図4に示す磁気ヘッド2000の場合には、図10の位置ずれマージンからすると、削り量d3が150μm程度であるのが好ましいといえる。

【0054】次に、記録再生装置Aにおけるその他の構成について以下説明する。なお、以下で特に断らない限り、「磁気ヘッド1000」は「磁気ヘッド2000」と読み替えることができるものとする。つまり、磁気ヘッド1000を用いた場合として説明した部分は、磁気ヘッド2000を用いた場合にも適用できる。

【0055】磁気ヘッド保持・移動機構10は、磁気ヘッド1000を保持するとともに、磁気ヘッド1000を光磁気記録媒体としての光磁気ディスクT（以下単に「ディスクT」とする）のタンジェンシャル方向（「トラック方向の接線方向」ともいう）及びラジアル方向（半径方向ともいう）に移動させるものであり、図14に示すように、スライダー12と、アーム13と、支持板14と、バネ16A、16Bと、磁石17A、17Bと、コア18と、コイル19と、天板15と、ピエゾ素子20、24とを有している。

【0056】ここで、スライダー12は、磁気ヘッド1000を保持するとともに、ディスクTが回転することによって磁気ヘッド1000をディスクTから浮上させるためのものであり、光磁気記録媒体T側の面が平面状に形成されている。つまり、光磁気ディスクTが回転することによって、ディスクTとスライダー12との間に空気が入ることによって磁気ヘッド1000をディスクTから浮上させる。

【0057】また、アーム13は、板バネ状を呈し、その端部にはスライダー12が取り付けられている。このアーム13は、スライダー12をディスクTを法線方向、つまり、垂直方向に押しつけている。その結果、ディスクTが回転することによる浮上力と、アーム13がスライダー12を法線方向に押しつける力とが釣り合った位置で、磁気ヘッド1000の浮上量が一定となる。通常、浮上時のディスクTと磁気ヘッド1000との間隔は、5μm程度である。

【0058】支持板14は、4本のバネ16A、16Bにより天板15と接続されており、天板15は、支持板25を介して光ピックアップ27の支持板26と接続されている。従って、光ピックアップ27がディスクTのラジアル方向DR2にシークすると、支持板26、支持板25、天板15、支持板14、およびアーム13を介

して磁気ヘッド1000もディスクTのラジアル方向DR2に移動する。従って、レーザ光の光軸と磁界の中心との位置合わせを一度行えば、光ピックアップ27のシーケによりレーザ光の光軸と磁界の中心とはずれることがない。ここで、支持板25と支持板26とで連結部Uを構成する。

【0059】天板15には、2つの磁石17A、17Bが取り付けられており、磁石17Aと磁石17Bとの間に、コイル19を巻回されたコア18が支持板14上に形成されている。従って、コイル19に電流を流すことによりコイル19は、磁石17A、17Bから磁力を受け、支持板14はディスクTの法線方向DR3に移動する。これにより、板バネ状のアーム13がスライダー12をディスクTに押しつける。

【0060】コア18に巻回されたコイル19に電流を流すとコイル19が磁力を受ける原理について、図15等を参照して説明する。コア18に巻回されたコイル19に電流を流すと、磁石17A側と磁石17B側とではコイル19に流れる電流の方向は互いに逆方向になる。そして、磁石17Aと磁石17Bとを同じN極で構成すれば、磁石17Aからは磁力線61がコイル19の方向に出射され、磁石17Bからは磁力線60がコイル19の方向に出射される。その結果、磁石17A側のコイル19は磁力62を受け、磁石17B側のコイル19は磁力63を受ける。磁力62と磁力63とは同じ方向の力であるので、コア18は一定方向に移動する。

【0061】再び、図14を参照して、図15を参照して説明した原理により、支持板14上に設けたコア18およびコイル19は、ディスクTの法線方向DR3に移動する。コイル19に流す電流の方向を変化させることにより、コア18およびコイル19をディスクTに近づく方向、または、ディスクTから遠ざかる方向に移動可能である。これにより、板バネ状のアーム13を介してスライダー12をディスクTに適度に押しつけることができる。

【0062】また、磁気ヘッド1000をディスクTのタンジェンシャル方向DR1に移動させるために支持板14にピエゾ素子(図14では省略)を設置し、磁気ヘッド1000をディスクTのラジアル方向DR2に移動させるために支持板14にピエゾ素子20が設けられている。

【0063】図16等を参照して、磁気ヘッド1000をディスクTのタンジェンシャル方向DR1とラジアル方向DR2に移動させる機構について説明する。磁気ヘッド1000をディスクTのタンジェンシャル方向に移動させるためにピエゾ素子24が支持板14に設けられている。ピエゾ素子20に所定の電圧を印加することによりピエゾ素子20がディスクTのラジアル方向DR2に膨張し、支持板14、アーム13がディスクTのラジアル方向DR2に移動し、磁気ヘッド1000がディス

クTのラジアル方向DR2に移動する。ピエゾ素子20に印加する電圧値を制御することによりピエゾ素子20の膨張割合を変化させることができ、磁気ヘッド1000のディスクTのラジアル方向DR2の位置を調整できる。

【0064】また、ピエゾ素子24に所定の電圧を印加することによりピエゾ素子24がディスクTのタンジェンシャル方向DR1に膨張し、支持板14、アーム13がディスクTのタンジェンシャル方向DR1に移動し、磁気ヘッド1000がディスクTのタンジェンシャル方向DR1に移動する。ピエゾ素子24に印加する電圧値を制御することによりピエゾ素子24の膨張割合を変化させることができ、磁気ヘッド1000のディスクTのタンジェンシャル方向DR1の位置を調整できる。

【0065】なお、本実施例におけるディスクTは、ラジアル方向(つまり、半径方向)にランド500とグループ510とが交互に配置された構造をしており(図18等参照)、ディスクTの断面を示すと、図26に示すように形成されている。つまり、磁気ヘッド1000側から、保護層5010、記録層5008、中間層(非磁性層)5006、拡大再生層5004、保護層5002、透明基板5000が順次形成された断面構造をしている。なお、ランドとグループとともに、上記のような断面構造をしている。

【0066】なお、透明基板5000は、ガラス、ポリカーボネート等から形成されていて、保護層5002は、SiNから形成されていて、拡大再生層5004は、室温付近に補償温度を持つGdFeCoから形成されていて、中間層5006は、SiNから形成されていて、記録層5008は、室温付近に補償温度を持つTbFeCoから形成されていて、保護層5010は、SiNから形成されている。

【0067】保護層5002を形成するSiN、拡大再生層5004を形成するGdFeCo、中間層5006を形成するSiN、記録層5008を形成するTbFeCo、保護層5010を形成するSiNは、マグネットスピッタ法により形成されている。また、保護層5002の膜厚は70μm、拡大再生層5004の膜厚は30μm、中間層5006の膜厚は15μm、記録層5008の膜厚は50μm、保護層5010の膜厚は70μmである。

【0068】また、図1を参照して、光ピックアップ27は、ディスクTにレーザ光を照射して、その反射光を検出するもので、レーザを照射する発光素子としての発光部と、該発光部から照射されたレーザを集光する対物レンズと、対物レンズを光磁気ディスクTの半径方向及び垂直方向に移動させるアクチュエータと、ディスクTから反射したレーザ光を受光する受光素子である受光部等を有している。

【0069】また、再生信号增幅回路100は、光ピッ

クアップ27からのフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号、光磁気信号及びファインクロックマーク信号を所定のレベルに増幅し、フォーカスエラー信号及びトラッキングエラー信号をサーボ回路130に出力し、光磁気信号をBPF160に出力し、ファインクロックマーク信号を同期信号生成回路120に出力する。【0070】また、同期信号生成回路120は、ファインクロックマークに基づいてクロックを生成し、その生成したクロックをサーボ回路130、BPF160、イコライザ170、復調回路220、駆動信号生成回路260等に出力する。

【0071】また、サーボ回路130は、再生信号増幅回路100から入力されたフォーカスエラー信号及びトラッキングエラー信号に基づいて、光ピックアップ27の対物レンズ28のフォーカスサーボ及びトラッキングサーボを行なうようにサーボ機構140を制御する。また、このサーボ回路130は、同期信号生成回路120から入力されたクロックに基づいてスピンドルモータ150を所定の回転数で回転させる。

【0072】また、サーボ機構140は、サーボ回路130からの制御に基づいて光ピックアップ27の対物レンズ28のフォーカスサーボ及びトラッキングサーボを行なう。

【0073】また、スピンドルモータ150は、ディスクTを所定の回転数で回転させる。

【0074】また、BPF160は、同期信号生成回路120からのクロックに同期して、再生信号増幅回路100から入力された光磁気信号の高域側と低域側をカットする。

【0075】また、イコライザ170は、同期信号生成回路120からのクロックに同期して、BPF160からの光磁気信号の波形干渉を除去する。

【0076】また、復調回路220は、同期信号生成回路120からのクロックに同期して、イコライザ170から出力された光磁気信号を復調して再生データとして出力する。

【0077】また、比較回路230は、復調回路220からの再生データと、記録データとを比較して、その比較結果の信号を制御回路235に送る。

【0078】また、制御回路235は、磁気ヘッド保持・移動機構10を制御するための信号を磁気ヘッド保持・移動機構10に対して出力する。

【0079】つまり、ディスクTに信号を記録する際には、制御回路235は、磁気ヘッド1000の第2の脚部1106を光ピックアップ27の光軸が通るように、磁気ヘッド1000をディスクTの半径方向に移動させるための信号を出力する。つまり、ディスクTの記録位置に垂直方向(法線方向)に磁界が照射されるようにする。より好ましくは、光ピックアップ27からのレーザ光の光軸と磁気ヘッド1000の軸線(つまり、磁界の

中心線)とが一致する位置に磁気ヘッド1000が来るよう、ピエゾ素子24を調整する信号を出力する。

【0080】一方、ディスクTから信号を磁区拡大再生する際には、制御回路235は、磁気ヘッド1000が光ピックアップ27の光軸に対して、ディスクTのタンジェンシャル方向にずれた位置となるように、磁気ヘッド1000をディスクTのタンジェンシャル方向に移動させるための信号を出力する。詳しくは後述する。

【0081】また、エンコーダ240は、記録データをエンコードする。また、変調回路250は、記録信号を所定の方式に変調する。

【0082】また、駆動信号生成回路260は、信号をディスクTに記録する際には、同期信号生成回路120からのクロックに基づいて、変調回路250からの記録信号により変調された磁界を生成するための駆動信号を生成し、その生成された駆動信号を磁気ヘッド駆動回路280に出力する。また、この駆動信号生成回路260は、記録に適した強度の磁界が磁気ヘッド1000から発生されるように、磁気ヘッド駆動回路280へ所定の信号を送る。さらに、この駆動信号生成回路260は、レーザ光が所定の強度及び変調パターンにて発光されるように、レーザ駆動回路290へ所定の信号を送る。

【0083】一方、ディスクTから信号を磁区拡大再生する場合には、駆動信号生成回路260は、同期信号生成回路120からのクロックに基づいて生成した駆動信号を磁気ヘッド駆動回路280へ出力する。さらに、駆動信号生成回路260は、レーザ光が所定の強度及び変調パターンにて発光されるように、レーザ駆動回路290へ所定の信号を送る。

【0084】また、磁気ヘッド駆動回路280は、駆動信号生成回路260からの駆動信号に基づいて磁気ヘッド1000を駆動する。

【0085】また、レーザ駆動回路290は、駆動信号生成回路260からの駆動信号に基づいて、光ピックアップ27における発光部を駆動する。

【0086】上記構成の記録再生装置Aの動作について説明する。まず、この記録再生装置Aにより信号を記録する場合には、記録位置の垂直方向に磁気ヘッド1000が来るように制御する。つまり、図17、図18に示すように、レーザ光の光軸Kが第2の脚部1106を通るように、磁気ヘッド1000を位置制御する。つまり、制御回路235は、磁気ヘッド保持・移動機構10に対して、レーザ光の光軸が磁気ヘッド1000の第2の脚部1106を通る位置に来るように磁気ヘッド1000を位置制御させる制御信号を出力し、磁気ヘッド保持・移動機構10においては、この制御信号に基づいて、ピエゾ素子24を制御して、光軸Kが第2の脚部1106を通る位置に来るようにする。つまり、磁気ヘッド1000が位置制御される位置にない場合には、ピエゾ素子を制御して磁気ヘッド1000を移動制御させ

る。この場合、制御回路235は、上記磁気ヘッド位置制御部、磁気ヘッド制御部として機能する。

【0087】磁気ヘッド1000の位置を上記のように制御することにより、磁気ヘッド1000と光ピックアップ27とがディスクTの垂直方向に重なり合い、ディスクTの記録位置に印加される磁界の最大磁力成分がディスク面の法線方向（つまり、垂直方向）となるようになる。

【0088】なお、より好ましくは磁気ヘッド1000の第2の脚部1106の中心、つまり、軸線Jと、光軸Kとが一致するように、磁気ヘッド1000を位置制御する。

【0089】記録データは、エンコーダ240によりエンコードされ、変調回路250により所定の方式に変調された後、駆動信号生成回路260に入力される。駆動信号生成回路260は、クロックの位相に対して一定量遅延されたクロックに同期し、記録信号により変調された磁界を生成するための駆動信号を生成し、磁気ヘッド駆動回路280へ出力する。磁気ヘッド駆動回路280は、入力された駆動信号に基づいて、磁気ヘッド1000を駆動し、磁気ヘッド1000は、記録信号により変調された磁界をディスクTに印加する。また、駆動信号生成回路260は、信号を記録するのに充分な強度を有するレーザ光を生成するための駆動信号を生成し、レーザ駆動回路290へ出力する。レーザ駆動回路290は、入力された駆動信号に基づいて光ピックアップ27中の発光部を駆動し、光ピックアップ27は、レーザ光をディスクTに照射する。これにより、信号をディスクTに記録できる。

【0090】なお、磁気ヘッド2000の場合も、上記と同様に位置制御され、図21に示すように、レーザ光の光軸Kが第2の脚部2106を通るように、磁気ヘッド2000が位置制御される。なお、より好ましくは磁気ヘッド2000の第2の脚部2106の中心、つまり、軸線Jと、光軸Kとが一致するように、磁気ヘッド2000を位置制御する。なお、ランドとグループの両方に記録可能である。

【0091】次に、再生時には、磁気ヘッド1000が光ピックアップ27の光軸に対して、ディスクTのタンジェンシャル方向にずれた位置となるように、磁気ヘッドを位置制御する。つまり、磁気ヘッド1000が位置制御される位置にない場合には、磁気ヘッド1000をディスクTのタンジェンシャル方向に移動させる。つまり、図19、図20に示すように、レーザ光の光軸Kと磁気ヘッド1000の軸線Jとがタンジェンシャル方向に所定間隔ずれるように、磁気ヘッド1000を該タンジェンシャル方向に移動させた上で再生処理を行なう。

【0092】ここで、磁気ヘッド1000をタンジェンシャル方向に移動させる場合には、制御回路235は、磁気ヘッド保持・移動機構10に対して、レーザ光の光

軸Kと磁気ヘッド1000の軸線Jとがタンジェンシャル方向に所定間隔ずれるように磁気ヘッド1000を移動制御させる制御信号を出力し、磁気ヘッド保持・移動機構10においては、この制御信号に基づいて、ピエゾ素子24を制御して、磁気ヘッド1000軸線Jがレーザ光の光軸Kと所定間隔ずれるようにする。その場合、磁気ヘッド1000の光ピックアップ27に対する移動量（又は磁気ヘッド1000の軸線Jとレーザ光の光軸Kとの間隔の情報）の情報を予め記憶させてある場合には、該移動量（又は間隔）の情報を読み出して、その移動量を移動するように制御する。該移動量とは、記録時から再生時に切り替わった際に、磁気ヘッド1000を光ピックアップ27に対して移動させる移動量である。2つのタンジェンシャル方向のうち、いずれの方向に移動させるかは予め設定しておく。なお、記録時において、上記光軸Kと磁気ヘッド1000の軸線Jが一致している場合には、該移動量と該間隔は同じである。なお、該移動量（又は間隔）は図19、図20において、L1で示される。この場合、制御回路235は、上記磁気ヘッド位置制御部、磁気ヘッド制御部として機能する。

【0093】なお、磁気ヘッド2000の場合も、上記と同様に位置制御され、図22に示すように、磁気ヘッド2000の軸心Jと光軸Kとの間隔がL2になるように移動制御される。

【0094】そして、ディスクTに記録された信号を再生していく。つまり、コイル1110に電流を印加することにより、磁気ヘッド1000によりタンジェンシャル方向に傾斜した磁界を再生対象の磁区に照射するとともに、光ピックアップ27により、レーザ光を照射してその反射光を検出する。

【0095】より具体的には、制御回路235からの制御により駆動信号生成回路260は、交番磁界を発生させるための駆動信号を生成し、この駆動信号を磁気ヘッド駆動回路280に出力する。また、駆動信号生成回路260は、レーザ駆動回路290を制御するための駆動信号をレーザ駆動回路290に出力する。

【0096】磁気ヘッド駆動回路280は、入力された駆動信号に基づいて、磁気ヘッド1000を駆動し、磁気ヘッド1000は交番磁界を発生する。その際、磁気ヘッド1000は再生すべき磁区に対してタンジェンシャル方向にずれた位置、つまり、再生したい所望の磁区に対して印加される磁界の角度が、ディスクTの法線方向に対して、35度～45度（好ましくは40度）に傾斜するように位置制御されているので、ディスクTのタンジェンシャル方向に対しては45度～55度（好ましくは50度）に傾斜するように位置制御されることになり、結果として、該磁区に印加される磁界の角度はディスクTのタンジェンシャル方向に対して約50度となる。

【0097】また、レーザ駆動回路290は、駆動信号

生成回路260からの駆動信号に基づいて光ピックアップ27中の発光部を駆動し、これにより、光ピックアップ27からはレーザ光が照射される。そして、光ピックアップ27の受光部により上記光磁気信号が検出される。

【0098】そして、光ピックアップ27により検出された光磁気信号は、再生信号增幅回路100、BPF160、イコライザ170を介して復調回路220で復調されて比較回路230に送られる。

【0099】なお、再生時における磁気ヘッド1000の移動量（又はレーザ光の光軸と磁気ヘッド1000の軸線との間の間隔）の情報を予め記憶しておかない場合には、図23に示すように、該移動量と補助コイル印加電流値を設定することができる。

【0100】つまり、まず、使用者により再生操作があったか否かが判定される（S10）。そして、再生操作があったと判定された場合には、ディスクTを装着した後最初の再生であるか否かが判定される（S11）。このステップS10、S11の判定は、制御回路235等により行われる。

【0101】そして、ディスクTを装着した後最初の再生である場合には、ステップS12に移行して、キャリブレーション・パターンをディスクTに記録する（S12、記録工程）。つまり、光ピックアップ27からレーザ光を照射しながら、記録層1008を磁化させて記録を行っていく。なお、この記録時には、磁気ヘッド1000と光ピックアップ27とは、光ピックアップ27からのレーザ光の光軸が第2の脚部1106を通る位置にあり、さらに好ましくは、該光軸と磁気ヘッド1000の軸線とは一致しており、ディスクTの記録位置には、垂直方向に磁界が照射されることになる。キャリブレーション・パターンは例えば制御回路235に記憶しておき、制御回路235は、このキャリブレーション・パターンのデータをエンコーダ240に送ることにより、以後は上記の記録時の動作に従いディスクTに記録を行なう。

【0102】次に、磁気ヘッド1000をタンジェンシャル方向に移動させる（S13、移動工程）。つまり、磁気ヘッド保持・移動機構10を制御して、磁気ヘッド1000をタンジェンシャル方向に移動させる。なお、移動させる距離は、予め設定されているデフォルト値とし、2つのタンジェンシャル方向のうちいずれの方向とするかは予め設定しておく。

【0103】次に、ステップS13において記録したキャリブレーション・パターンを再生する（S14、再生工程）。つまり、コイル1110に電流を印加することにより、磁気ヘッド1000により、タンジェンシャル方向に傾斜した磁界を再生対象の磁区に照射するとともに、光ピックアップ27により、レーザ光を照射してその反射光を検出して再生を行なう。つまり、光ピックアップ27により検出された光磁気信号は、再生信号增幅回路100、BPF160、イコライザ170を介して復調回路220で復調されて比較回路230に送られる。

【0104】そして、比較回路230は、記録したキャリブレーション・パターンと、再生したキャリブレーション・パターンとを比較して、そのビットエラーレートを検出し、検出したビットエラーレートが所定の範囲内（例えば、 $< 10^{-5}$ ）であるか否かを判定する（S15、判定工程）。

【0105】そして、判定結果が所定の範囲内であれば、移動量の情報を記憶しておき（S16）、その後、実際にディスク5に記録されたデータの再生を行なう（S17）。つまり、ステップS16においては、ステップS18において磁気ヘッドをずらす処理をした場合には、移動量のデフォルト値とそのずらし量をふまえた値が記憶される。なお、ステップS18での磁気ヘッドをずらす処理をしていない場合には、デフォルト値はすでに記憶されているので、敢えてステップS16で記録する必要はない。

【0106】一方、ステップS15において、検出したビットエラーレートが所定の範囲内ではない場合には、磁気ヘッド1000の位置をタンジェンシャル方向にずらす処理を行う（S18、移動量変化工程）。

【0107】そして、磁気ヘッド位置をずらす回数が所定の回数以内であるか否かを判定し（S19）、該回数が該所定の回数以内であれば、再びステップS14に戻って、再生を行い（S14）、その後判定を行なう（S15）。この場合のステップS14は上記第2再生工程に当たり、ステップS15は上記第2判定工程に当たり、ステップS14、S15、S18を繰り返す工程が上記繰り返し工程に当たる。一方、ステップS19の判定において、ずらす回数が所定の回数を超えている場合には、処理を終了する。

【0108】なお、ステップS11において、1回目の再生ではないと判定された場合には、ステップS16で記憶されている電流値と移動量の情報を読み出し（S20）、該磁気ヘッド1000を移動した上で（S21）、再生処理を行なう（S17）。

【0109】なお、図23の動作は、磁気ヘッド2000にも適用可能であることはいうまでもない。

【0110】図24、図25を参照して、ディスクTの面内方向の磁界成分を含む磁界を印加してディスクTから磁区拡大再生する原理について説明する。図24を参照して、記録層に磁区32が形成されている場合に、磁区32から漏洩する光磁気記録媒体としてのディスクTに垂直な方向の漏洩磁界の強度分布は、磁区32の両端から中央に向かうに従って強度が強くなり、中央部では磁界34を有する分布33になる。そして、磁区32の両端の外側では磁界34と反対方向の磁界35、36が

存在する(図24(a))。一方、磁区32から漏洩する光磁気記録媒体の面内方向の漏洩磁界の強度分布は、磁区32の両端で強度が最大となり、互いの反対方向の磁界分布となる(図24(b))。ディスクTの面内方向の磁界成分を含む磁界を印加すると、磁区32から漏洩する面内方向の漏洩磁界の分布は、磁区32の一方端で強い磁界36を有し、磁区32の他方端では、磁界36と反対方向で磁界36より弱い磁界37を有する分布になる(図24(c))。従って、ディスクTの面内方向の磁界成分を含む磁界を印加することにより磁区32の一方端での面内方向の磁界が強くなり、非磁性層を介して静磁結合により再生層へ磁区が転写され易くなる。

【0111】図25を参照して、ディスクTの磁性層83は、再生層831、非磁性層832、および記録層833等から成り、記録層833には、記録信号に基づいて方向が異なる磁化を有する磁区が形成されている。なお、この磁性層83は、図26との対応では、透明基板5000を除く構成がこれに当たり、再生層831は拡大再生層5004に対応し、非磁性層832は中間層5006に対応し、記録層833は記録層5008に対応する。そして、磁区拡大再生される場合には、再生層831は一定方向の磁化を有するように初期化され、再生層831側からレーザ光LBが照射される。記録層833の各磁区の境界には、面内方向の漏洩磁界40、41、42、43、44が存在している。レーザ光LBが照射されることにより磁区8330の領域の温度が上昇し、漏洩磁界41、42の強度が強くなる。そして、漏洩磁界41の方向と同じ方向の磁界成分H211を含む磁界H21を境界8331に印加することにより、漏洩磁界41は漏洩磁界42より強くなる。そして、漏洩磁界41の方向と同じ方向の磁界成分H211を含む磁界H21を境界8331に印加することにより、漏洩磁界41は漏洩磁界42より強くなり、再生層831の磁化8310に対して磁力45を及ぼす(図25(a))。磁力45が及ぶと磁化8310は磁力45の方向に回転し易くなり、再生層831には磁区8330の磁化と同じ方向の磁化を有する種磁区8311が現れる。そして、印加した磁界H21には、種磁区8311の磁化の方向と同じ方向の磁界H212も含まれるため、種磁区8311は矢印46で示す方向に拡大して再生層831には拡大された磁区8312が現れる。そして、磁区8312をレーザ光LBにより検出することにより、記録層833の磁区8330が磁区拡大再生される(図25(b))。磁区8312が検出された後、磁界H21と反対方向の磁界を印加することにより磁区8312は消滅し、再生層831は初期化された状態に戻る。従って、漏洩磁界41と同じ極性の漏洩磁界43が存在する境界に磁界H21を印加することにより磁区の一方端から優先的に再生層831へ磁区の転写・拡大が生じ、磁区拡大再生をすることができ、磁界H21と反対方向の

磁界を印加することにより再生層831へ転写・拡大した磁区を消滅させることができる。

【0112】なお、上記の説明においては、ディスクTに記録された信号を再生する際には、上記磁気ヘッド1000をディスクTのタンジェンシャル方向に移動制御してタンジェンシャル方向に斜めに磁界を印加するものとして説明したが、これには限られず、ディスクTのラジアル方向、つまり、半径方向に移動制御して、該半径方向に斜めに磁界を印加するようにしてもよい。

【0113】

【発明の効果】本発明に基づく磁気ヘッドによれば、光磁気記録媒体の法線方向に対して傾斜した磁界を発生させることができ、また、磁気ヘッドの位置ずれマージンが最も良好な状態で動作させることができるとなる。

【0114】また、本発明に基づく記録再生装置によれば、光磁気記録媒体への信号の記録時には、光磁気記録媒体の法線方向に磁界を印加でき、また、光磁気記録媒体からの再生時には、光磁気記録媒体のタンジェンシャル方向に磁界を印加できるので、信号の記録と再生を正確に行なうことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例に基づく記録再生装置の構成を示すブロック図である。

【図2】本発明の実施例に基づく磁気ヘッドの構成を示す斜視図である。

【図3】磁気ヘッドの動作を示す説明図である。

【図4】本発明の実施例に基づく磁気ヘッドの構成を示す斜視図である。

【図5】磁気ヘッドの動作を示す説明図である。

【図6】本発明の実施例に基づく磁気ヘッドのシミュレーション結果を示す説明図である。

【図7】本発明の実施例に基づく磁気ヘッドのシミュレーション結果を示す説明図である。

【図8】本発明の実施例に基づく磁気ヘッドのシミュレーション結果を示す説明図である。

【図9】本発明の実施例に基づく磁気ヘッドのシミュレーション結果を示す説明図である。

【図10】本発明の実施例に基づく磁気ヘッドのシミュレーション結果を示す説明図である。

【図11】本発明の実施例に基づく磁気ヘッドのシミュレーション結果を示す説明図である。

【図12】本発明の実施例に基づく磁気ヘッドの構成を示す説明図である。

【図13】本発明の実施例に基づく磁気ヘッドの構成を示す説明図である。

【図14】磁気ヘッド保持・移動機構と、光ピックアップと、連結部の構成を示す斜視図である。

【図15】磁気ヘッド保持・移動機構の動作原理を説明するための説明図である。

【図16】磁気ヘッド保持・移動機構の構成を示す要部

説明図である。

【図17】第1タイプの磁気ヘッドについて、記録時ににおける磁気ヘッドの配置位置を示す説明図である。

【図18】第1タイプの磁気ヘッドについて、記録時ににおける磁気ヘッドの配置位置を示す説明図である。

【図19】第1タイプの磁気ヘッドについて、再生時ににおける磁気ヘッドの配置位置を示す説明図である。

【図20】第1タイプの磁気ヘッドについて、再生時ににおける磁気ヘッドの配置位置を示す説明図である。

【図21】第2タイプの磁気ヘッドについて、記録時ににおける磁気ヘッドの配置位置を示す説明図である。

【図22】第2タイプの磁気ヘッドについて、再生時ににおける磁気ヘッドの配置位置を示す説明図である。

【図23】記録再生装置の動作を説明するためのフローチャートである。

【図24】ディスクに斜め方向の磁界を印加すると磁区の転写が生じやすいことを説明する説明図である。

【図25】ディスクに斜め方向の磁界を印加した磁区拡大再生の原理を示す説明図である。

【図26】MAMMOSにおいて用いられる光磁気記録媒体の構成を説明する説明図である。

【符号の説明】

A 記録再生装置

T ディスク

1000, 2000 磁気ヘッド

1100, 2100 コア

1110, 2110 コイル

1104, 2104 第1の脚部

1106, 2106 第2の脚部

1108, 2108 第3の脚部

10 磁気ヘッド保持・移動機構

27 光ピックアップ

100 再生信号增幅回路

120 同期信号生成回路

130 サーボ回路

140 サーボ機構

150 スピンドルモータ

160 BPF

170 イコライザ

220 復調回路

230 比較回路

235 制御回路

240 エンコーダ

250 變調回路

260 駆動信号生成回路

280 磁気ヘッド駆動回路

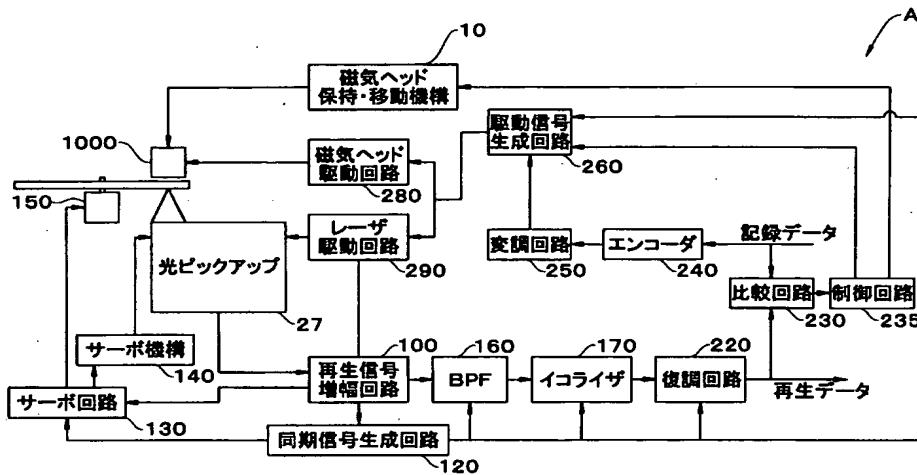
290 レーザ駆動回路

290 光ピックアップ

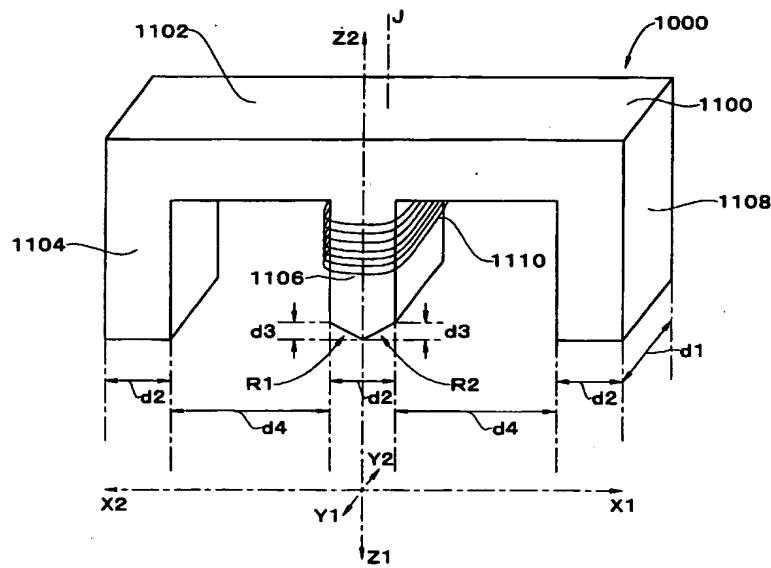
10

20

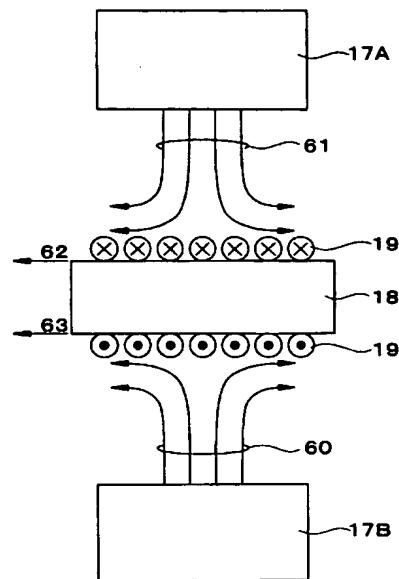
【図1】



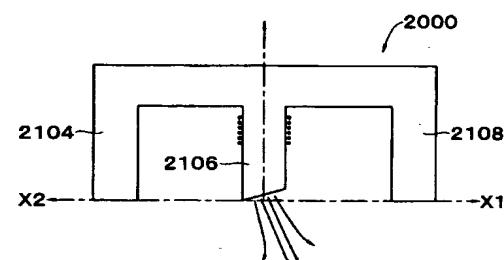
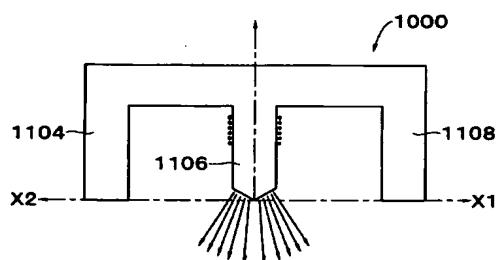
【図2】



【図15】

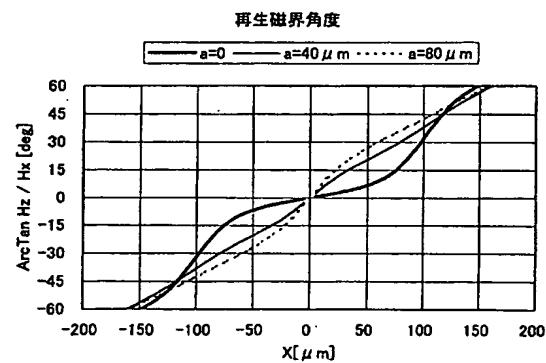


【図3】

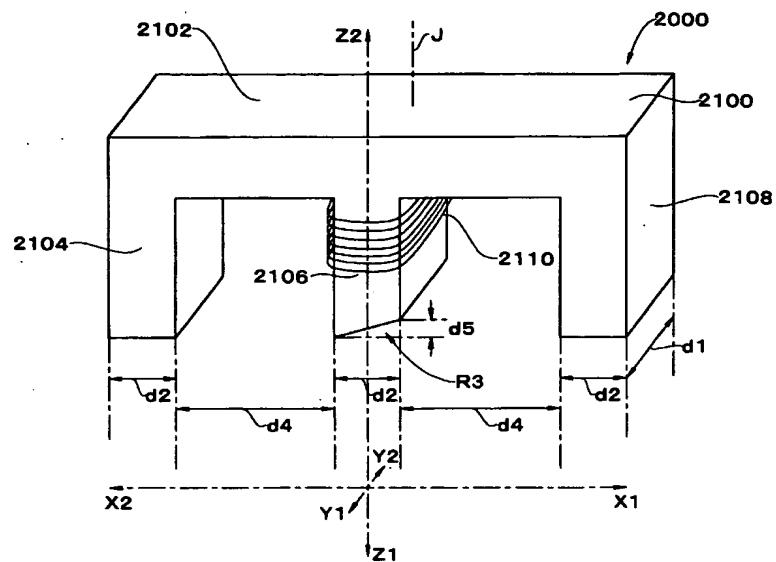


【図5】

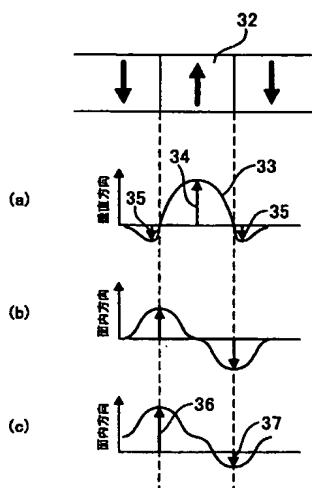
【図7】



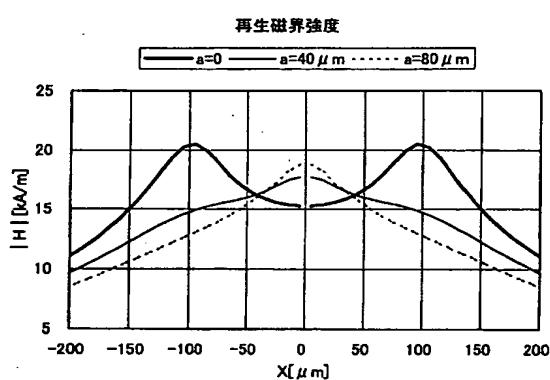
【図4】



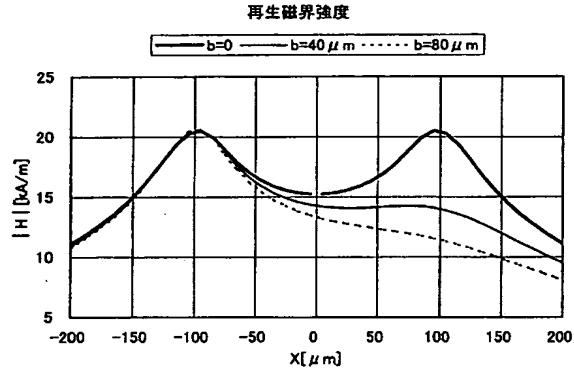
【図24】



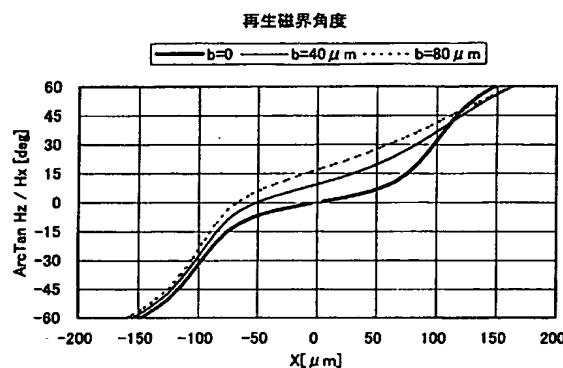
【図6】



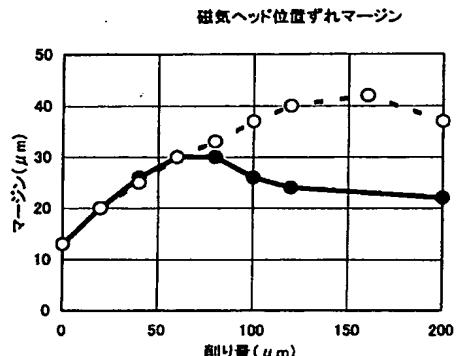
【図8】



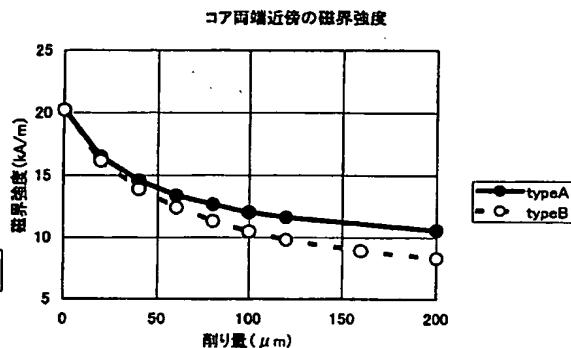
【図9】



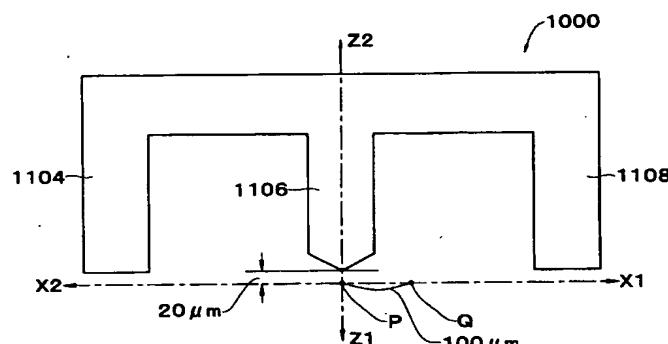
【図10】



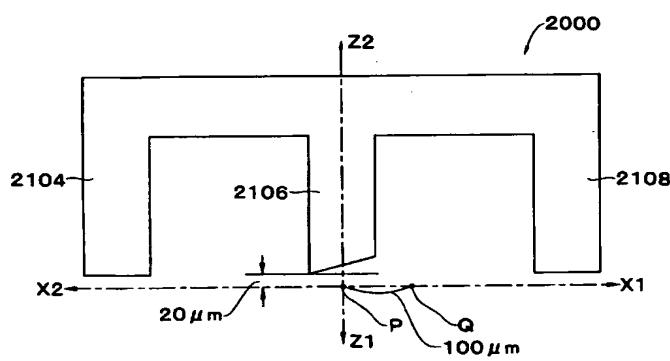
【図11】



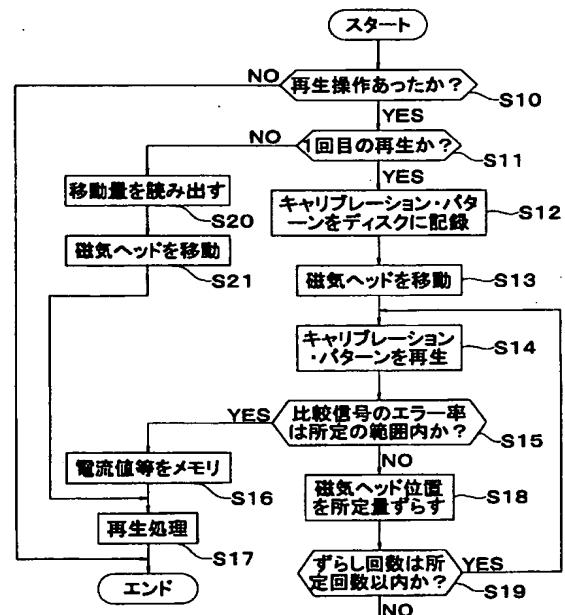
【図12】



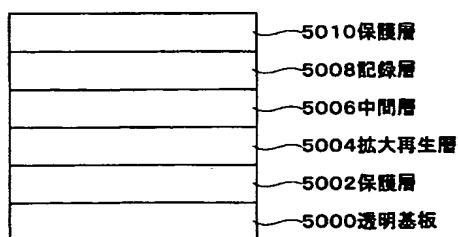
【図13】



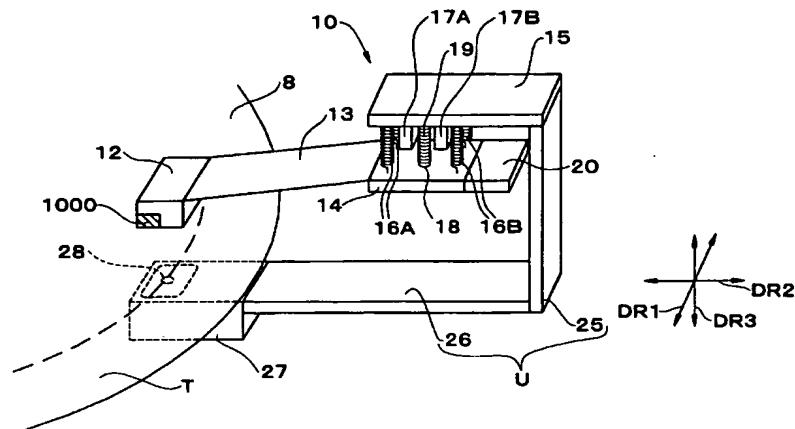
【図23】



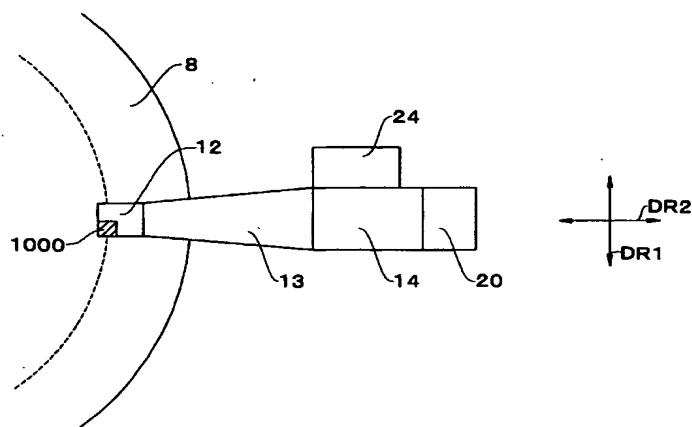
【図26】



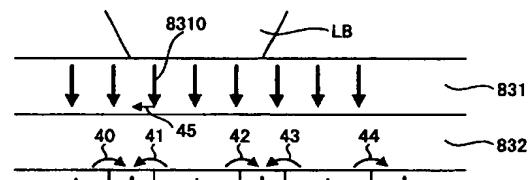
【図14】



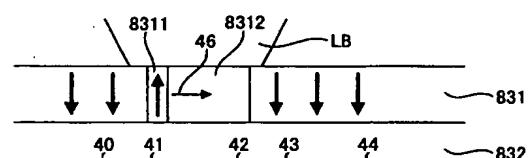
【図16】



【図25】

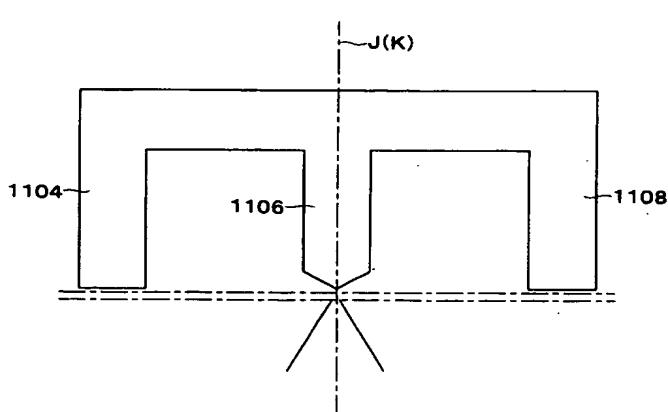


(a)

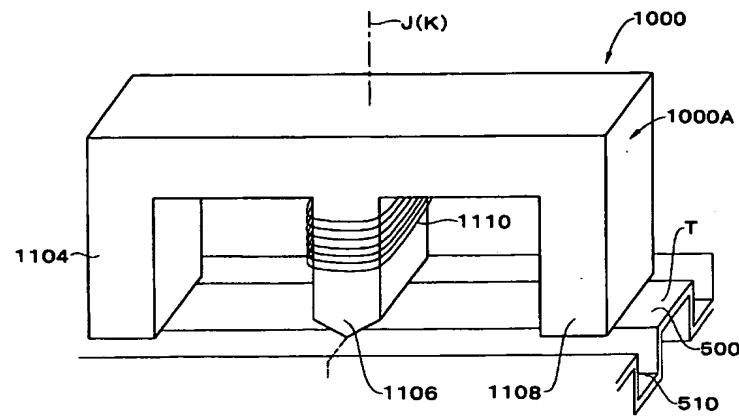


(b)

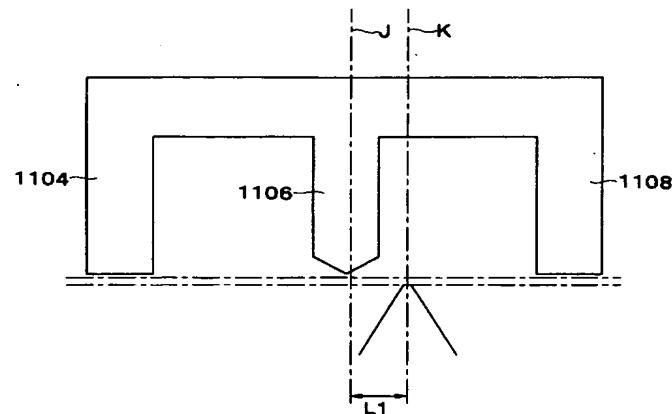
【図17】



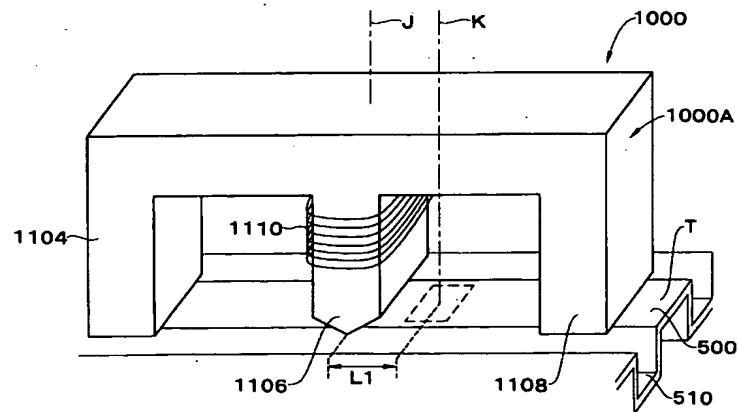
【図18】



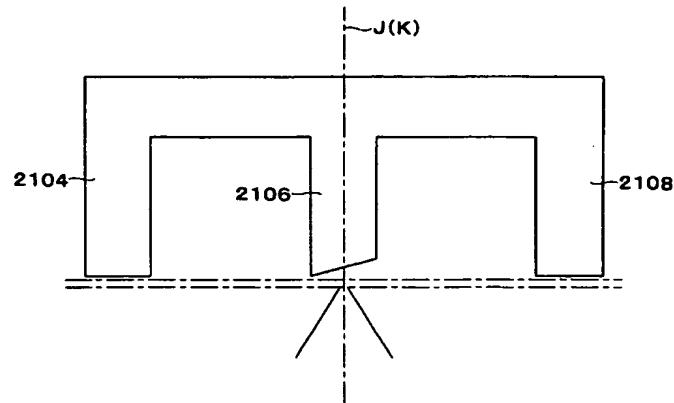
【図19】



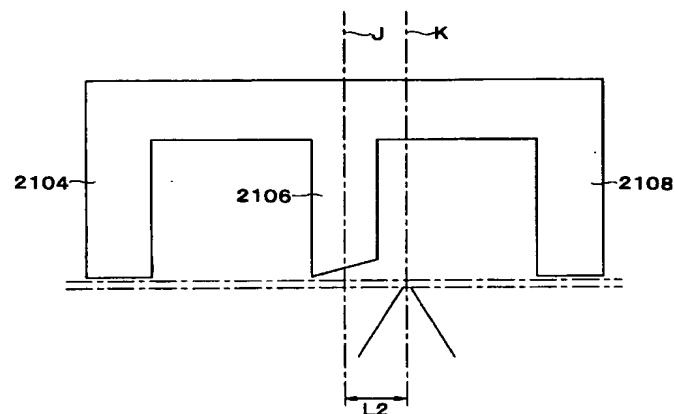
【図20】



【図21】



【図22】



フロントページの続き

(72)発明者 野口 仁志
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(72)発明者 山口 淳
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(72)発明者 石田 弘毅
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

F ターム(参考) 5D075 AA03 CC11 CC28 CF03 CF06